

KEK-PFにおける入射効率改善のための研究

平野広太

M170458

放射光物理研究室

高エネルギー加速器研究機構(KEK)にあるPhoton Factory(PF)は円形電子加速器を周回する電子ビームから発生する放射光を使って物性や生命科学の実験を行う施設である。加速器に蓄積された電子ビームは周回中に残留ガスとの散乱など、様々な要因で失われてゆくため、時々注ぎ足してやる必要があり、それを入射と呼ぶ。LINAC(線形加速器)で作られた電子ビームは、輸送路を通り、蓄積リングまで輸送される。輸送路終端には、入射ビームの向きを蓄積リングの軌道にそろえる為のセプタム電磁石が存在し、セプタム(横隔膜の意)板で入射ビームと蓄積ビームの間を仕切り、パルス的に励磁することで、板上の渦電流で蓄積側に磁場が漏れない工夫がなされている。入射ビームを蓄積リングのダクトに納めるには、入射ビームが蓄積リングに入った後で軌道を曲げて中心に近づける必要があるが、その際、同時に既にある蓄積ビームも必ず影響を受ける。そこで、蓄積リングに対してはその影響が打ち消されるよう、入射部分の上流で予め蹴っておくという操作がなされる。結果として蓄積ビームの軌道は、入射点付近で入射の瞬間のみ入射点側に移動する、ということになり、それを局所パルスバンプと呼んでいる。パルスバンプを作る電磁石をキッカーと呼び、リングの周回周期(PFの場合1.6s)の半正弦波波形で励磁され、入射ビームはそのピークのタイミングに合わせられる。パルス幅が短いため、高電圧、大電流の電源が必須となる。

さて、入射時の、キッカー誤差による蓄積ビームの振動は放射光の揺らぎとなり、入射ビームの損失は放射線が発生するので、どちらもできる限り抑制する必要がある。常時入射を行い、蓄積電流を一定に保つというトップアップが当たり前になった現在、入射中は実験を休止するという前提で作られたPFでは、入射点が遠い為に大きなキッカーバンプが必要であり、その為の特殊なパルス電源では複数台のキッカーの波形やタイミングを完全に一致させて誤差を現代的なレベルまで低減させることが極めて困難である。また、パルス磁石の磁場は環境やダクトに依存し、実験室での準備測定そのまではない。さらに、セプタムは1980年代製造である為、真内外の位置調整が極めて困難である上に、2011年の震災で正確な据付座標を失った。そのような中で、電子ビームを直接測定する手法により、現在の正確な入射状況を把握した上で、それを改善しようというのが本研究の目的である。

最初に、電子ビームを使ってパルス電磁石の波形や蹴り角、タイミングと入射点の位置情報の推定を行った。蓄積リングの間に何もない空間を挟んだ2点でのビームの位置情報があれば、その中央でのビームの位置と向きが得られる。そこから軌道を上流に遡れば、任意の位置の軌道情報が得られる。実際に、直線部両端のビーム位置モニタ(BPM)の電極からの生の電圧信号を、独自に開発した手法で解析し、微小電荷に対する正確な瞬時測定を可能にして入射パラメータ等の推定を行った。測定したパラメータを用いて、入射パラメータの最適化のシミュレーションを行い、ビームスタディで測定を行いながら最適化を進めるプログラムも開発した。実際にビームを使って最適化実験を行った結果、ほぼシミュレーション通りに最適化で

きることが分かり、実際に、入射タイミング以外のタイミングを含む、蓄積ビーム全体にわたって誤差による残留振動を小さくしながら、入射率を落とさないパラメータを発見することができた。